

Bitte
frankieren

EMPA
Frau Erika Krause
Abteilung Elektronik/Messtechnik
Überlandstr. 129
CH-8600 Dübendorf

■ Organisatorisches

Leitung: Dr. Urs Sennhauser

Ort: AKADEMIE
Überlandstrasse 129
CH-8600 Dübendorf

Datum: Montag, 24. Juni 2002

Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr

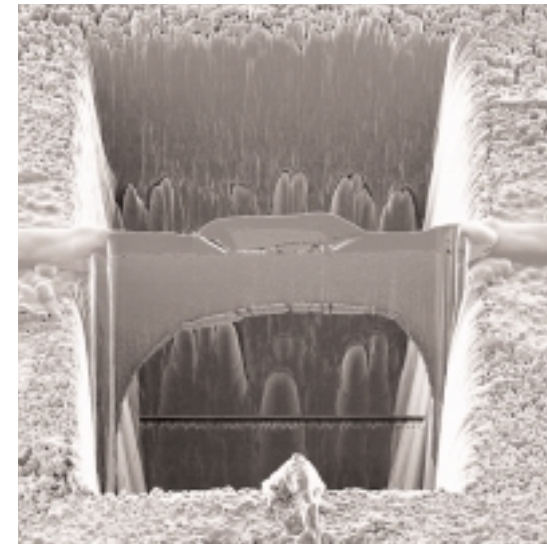
Anmeldung: bis spätestens 17. Juni 2002

EMPA, Elektronik/Messtechnik
Frau Erika Krause
Telefon +41 (0) 1 823 42 72
Fax +41 (0) 1 823 40 54
E-Mail erika.krause@empa.ch

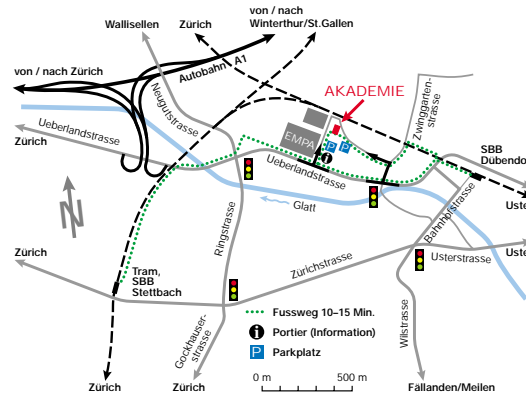


Einladung

Einweihungsfeier für die EMPA- FIB-Anlagen



■ Situationsplan



© EMPA, 2002 / FY_Krause

AKADEMIE

Überlandstrasse 129,
Dübendorf

Montag, 24. Juni 2002

10.00 – 16.00 Uhr

Die Rasterelektronenmikroskopie der Zukunft heisst FIB (Focused Ion Beam). Die ursprünglich für Halbleiteranwendungen konzipierten Rasterionenmikroskope erlauben nicht nur die hochauflösende Bildbetrachtung in verschiedenen Modi, sondern auch die mikrotechnische Bearbeitung der Probe. Mit dem primären, gerasterten Gallium-Ionenstrahl können örtlich präzise Mikro-Querschnitte hergestellt und in-situ inspiziert und ausgewertet werden. Auch ermöglichen die Geräte die zielgenaue Mikro-Deposition elektrisch leitender oder isolierender Schichten. Die Fehleranalyse und Reparatur von hochintegrierten Halbleiter-Schaltkreisen (ULSI) gehört ebenso zu den Anwendungsgebieten wie die Charakterisierung von dünnen Schichten und Oberflächenverschleiss in materialwissenschaftlichen Fragestellungen. Die EMPA hat nunmehr zwei solche Anlagen in Betrieb genommen, mit denen sie das gesamte Anwendungsspektrum abdeckt. Dabei stehen sowohl aktuelle Forschungsprojekte als auch eine zukunftssträchtige, hochwertige Dienstleistung für die Schweizer Industrie im Mittelpunkt.

■ ReferentInnen

Peter Jacob	EMPA, Elektronik/Messtechnik EM Marin SA
Dr. Ulrich Klotz	EMPA, Oberflächen- und Fügetechnik
Silke Liebert	Philips Semiconductors Zürich
Dr. Andreas Schertel	FEI Company München
Dr. Patrick Schmutz	ETHZ, Institut für Baustoffe und Korrosion

■ Programm

- 10.00 **Einführung**
Prof. Dr. Louis Schlapbach, Direktor EMPA
Dr. Urs Sennhauser, Abteilungsleiter
Elektronik/Messtechnik
- 10.30 **Wenn sonst nichts mehr geht ...
Beispiele für erfolgreiche FIB-Untersuchungen in materialwissenschaftlichen und halbleiterspezifischen Gebieten**
Peter Jacob
- 11.00 **Wenn der Zahn der Zeit nagt ...
Korrosionsuntersuchungen mit FIB an Metallproben**
Patrick Schmutz
- 11.30 **Kaffeepause**
- 12.00 **Chip-Modifikationen im FIB-Blindflug – mit Crashrisiken**
Silke Liebert
- 12.30 **Darfs noch ein bisschen dünner sein? – TEM-Präparationstechniken und Fallbeispiele am FIB**
Andreas Schertel
- 13.00 **Mittagessen Personalrestaurant EMPA**
- 14.15 **Wir blicken für Sie durch – TEM-Untersuchungen in der Materialwissenschaft**
Ulrich Klotz
- 14.40 **Fragerunde**
- 15.00 **FIB- und TEM-Vorfürungen**
Apéro
- 16.00 **Schluss**

Anmeldung



Einweihungsfeier FIB-Anlagen

FIB- und TEM-Vorfürungen

Montag, 24. Juni 2002, 10.00 – 16.00 Uhr

AKADEMIE, Überlandstrasse 129, CH-8600 Dübendorf

Anmeldung bitte bis spätestens **17. Juni 2002** per E-Mail oder mit diesem Talon per Brief oder Fax.

Frau Herr

Name _____

Vorname _____

Titel/Funktion _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail _____